

京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点
利用負担金内規

(平成23年 3月 23日拠点マネージャー裁定)

第1条 京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規（以下「利用内規」という。）第11条の規定に基づき負担すべき、装置等の利用負担金、基本料金及び技術料並びに実験室等の利用料金（以下「利用負担金等」という。）の額等については、この内規の定めるところによる。

第2条 装置等を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金及び基本料金の合計額とする。

- 2 ナノテクノロジーハブ拠点(以下「ハブ拠点」という。)職員による装置等の使用が必要な技術相談を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金とする。
- 3 技術代行及び技術補助（以下「技術代行等」という。）を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金及び技術料の合計額とする。

第3条 利用負担金の額は、別表第1に定める額とする。ただし、利用内規第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者については、利用負担金の額を別表第1に定める額の半額とする。

- 2 前項ただし書きのほか、利用内規別表第1の区分AからCまでの装置群を利用する場合においては、次の各号に掲げる者についても、利用負担金の額を別表第1に定める額の半額とする。
 - (1) 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
 - (2) 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業に則って研究成果を公開することについてあらかじめハブ拠点と合意した者であって、その所属する機関が中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者
- 3 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業に則って研究成果を公開することについてあらかじめハブ拠点と合意した者であって、前項第2号に掲げる者を除く者が利用内規別表第1の区分AからCまでの装置群を利用する場合においては、利用負担金の額を別表第1に定める額の8割に相当する額とする。
- 4 前3項の規定による利用負担金が、別表第2の負担上限額と同一の利用許可における利用負担金の累積額との差額を超える場合には、前3項の規定にかかわらず、その差額

を利用負担金の額とする。

第4条 利用者は希望により別表第2の負担上限額をあらかじめ納付しておくことにより、装置等の利用負担金を都度納付することなく利用ができる。この場合、使用実績に応じた利用負担金の累積額が別表第2の負担上限額を下回る場合にも、いったん納付された負担上限額との差額は返還しない。

第5条 基本料金の額は、別表第3に定める額とする。ただし、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の利用者については、基本料金を免除するものとする。

第6条 技術代行等における技術料の額は、別表4に定める額とする。

第7条 実験室等のうち、サテライトラボ（専有部分）及びセミナー室を利用する場合の利用料金の額は、別表第5のとおりとする。

第8条 装置等の利用中止に係るキャンセル料の額は、別表第6に定める額とする。

第9条 この内規に定めるもののほか、利用負担金等及びキャンセル料に関し必要な事項は、運営責任者が定める。

附 則

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月16日から施行する。

附 則

この内規は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1 装置等の利用負担金

装置等 装置群	機器名	利用料		設置場所	
		(一日当たり)	(一時間当たり)		
A ナノリソグラフィ 装置	高速高精度電子ビーム描画装置	325,296円	40,716円	イエロールーム	
	レーザー直接描画装置	88,344円	11,124円	イエロールーム	
	高速マスクレス露光装置	50,220円	6,372円	イエロールーム	
	レジスト塗布装置	9,720円	1,296円	イエロールーム	
	レジスト現像装置	9,720円	1,296円	イエロールーム	
	スプレーコータ	12,420円	1,620円	イエロールーム	
	ウエハスピン洗浄装置	18,144円	2,268円	イエロールーム	
	厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置	19,116円	2,484円	イエロールーム	
	両面マスクアライナー	35,100円	4,428円	イエロールーム	
	露光装置(ステッパー)	130,140円	16,308円	イエロールーム	
	ウェハ汚染計測装置	30,240円	3,780円	イエロールーム	
	紫外線露光装置	5,400円	756円	イエロールーム	
	液滴吐出描画装置	13,284円	1,728円	イエロールーム	
	有機現像液型レジスト現像装置	12,960円	1,620円	イエロールーム	
	E B露光装置	11,880円	1,512円	桂クリーンルーム	
	ステッパ	115,128円	14,472円	桂クリーンルーム	
	移動マスク紫外線露光装置	53,136円	6,696円	桂クリーンルーム	
	両面マスクアライナ露光装置	8,316円	1,080円	桂クリーンルーム	
	大面積超高精度電子線描画装置	429,408円	53,784円	加工・評価室	
	B ナノ材料加工・創製 装置	真空蒸着装置	7,668円	972円	加工・評価室
多元スパッタ装置(仕様A)		49,788円	6,264円	加工・評価室	
多元スパッタ装置(仕様B)		47,304円	5,940円	加工・評価室	
電子線蒸着装置		38,988円	4,968円	クリーンルーム1	
プラズマCVD装置		79,056円	9,936円	クリーンルーム1	
熱酸化炉		11,556円	1,512円	クリーンルーム2	
電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置		44,604円	5,616円	クリーンルーム2	
ドライエッチング装置		11,124円	1,404円	クリーンルーム2	
深掘りドライエッチング装置		64,908円	8,208円	クリーンルーム1	
磁気中性線放電ドライエッチング装置		65,016円	8,208円	クリーンルーム1	
シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム		52,056円	6,588円	クリーンルーム1	
シリコン犠牲層ドライエッチングシステム		26,244円	3,348円	クリーンルーム2	
紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置		55,620円	7,020円	イエロールーム	
基板接合装置		50,544円	6,372円	イエロールーム	
集束イオンビーム/走査電子顕微鏡		159,300円	19,980円	加工・評価室	
赤外フェムト秒レーザー加工装置		43,740円	5,508円	加工・評価室	
レーザーアニール装置		41,472円	5,184円	加工・評価室	
レーザーダイシング装置		83,484円	10,476円	加工・評価室	
真空マウンター		6,480円	864円	加工・評価室	
紫外線照射装置		2,916円	432円	加工・評価室	
エキスパンド装置		1,512円	216円	加工・評価室	
ダイシングソー		7,560円	972円	加工・評価室	
ウェッジワイヤボンダ		3,240円	432円	加工・評価室BF	
ボールワイヤボンダ		3,348円	432円	加工・評価室BF	
ダイボンダ		3,024円	432円	加工・評価室BF	
ナノインプリントシステム		13,284円	1,728円	イエロールーム	
赤外透過評価検査/非接触厚み測定機		12,528円	1,620円	イエロールーム	
バリレン成膜装置		4,428円	648円	桂クリーンルーム	
ICP-RIE装置		6,156円	864円	桂クリーンルーム	
簡易RIE装置		3,996円	540円	桂クリーンルーム	
ウエハ接合装置		56,160円	7,020円	桂クリーンルーム	
ナノインプリント装置		2,160円	324円	桂クリーンルーム	
ダイシング装置		7,020円	972円	桂クリーンルーム	
C ナノ材料分析・評価 装置		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	59,400円	7,452円	加工・評価室
		分析走査電子顕微鏡	82,728円	10,368円	加工・評価室
		真空プローバ	30,348円	3,888円	加工・評価室BF
		X線回折装置	33,480円	4,212円	加工・評価室
		触針式段差計1	5,724円	756円	クリーンルーム2
		触針式段差計2	5,724円	756円	加工・評価室
		マイクロシステムアナライザ	34,884円	4,428円	加工・評価室BF
		プローバ	7,776円	972円	加工・評価室BF
		高速液中原子間力顕微鏡	31,644円	3,996円	加工・評価室
		走査型プローブ顕微鏡システム	28,728円	3,672円	加工・評価室
		三次元粒子トラッキングシステム	24,084円	3,024円	加工・評価室
		共焦点レーザー走査型顕微鏡	30,780円	3,888円	加工・評価室
	全反射励起蛍光イメージングシステム	25,164円	3,240円	加工・評価室	
	長時間撮影蛍光イメージングシステム	19,116円	2,484円	加工・評価室	
	3D測定レーザー顕微鏡	12,312円	1,620円	加工・評価室	
	ゼータ電位・粒径測定システム	13,176円	1,728円	加工・評価室	
	分光エリブソメーター	20,412円	2,592円	クリーンルーム2	
	ダイナミック光散乱光度計	17,604円	2,268円	加工・評価室	
	パワーデバイスアナライザ	9,828円	1,296円	加工・評価室BF	
	インピーダンスアナライザ	4,104円	540円	加工・評価室BF	
	光ヘテロダイン微小振動測定装置	12,960円	1,620円	加工・評価室BF	
	超微小材料機械変形評価装置	12,960円	1,620円	加工・評価室BF	
	卓上顕微鏡(SEM)	4,752円	648円	クリーンルーム1	
	セルテストシステム	12,960円	1,620円	加工・評価室BF	
	マニュアルプローバ	4,320円	540円	加工・評価室	
	RFプローブキット	1,728円	216円	加工・評価室	
	ネットワークアナライザ	4,320円	540円	加工・評価室	
	半導体パラメータアナライザ	4,320円	540円	加工・評価室	
	D ナノ微細構造解析 装置	極低温高分解能透過電子顕微鏡	41,200円	5,150円	極低温電子顕微鏡棟9-1室
		球面収差補正透過電子顕微鏡	32,960円	4,120円	極低温電子顕微鏡棟9-2室
モノクロメータ搭載低加速原子分解能分析電子顕微鏡		46,400円	5,800円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟3号室	
集束イオンビーム装置		16,000円	2,000円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟3号室	
精密イオン研磨装置		2,400円	300円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟3号室	
マイクローム		2,400円	300円	極低温電子顕微鏡棟9-2室	
ディンプリング装置	1,200円	150円	共同研究棟CL-203室		

備考

- 1 上記表中の利用料は、1日又は1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額を利用負担金とする。
- 2 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用負担金を算出するものとする。
- 3 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額を利用負担金とする。
- 4 第3条第1項ただし書きに掲げる者及びAからCまでの装置群を利用する者で同条第2項各号に掲げる者が装置等を利用する場合の利用料は、上記表中の利用料を半額にして算出するものとし、円未満に端数が出た場合はその端数を切り上げるものとする。
- 5 AからCまでの装置群を利用する者で第3条第3項に掲げる者が装置等を利用する場合の利用料は、上記表中の利用料を0.8を乗じて算出するものとし、円未満に端数が出た場合はその端数を切り上げるものとする。
- 6 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、設置場所に応じて別表第3の基本料金を負担しなければならない。

別表第2 利用負担金の上限額

利用者種別	利用料（1テーマ当たり）
第3条第1項ただし書き及び第2項第1号および第2号に掲げる者	324万円
上記以外の者	1,080万円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む。）である。

別表第3 装置等利用に係る実験室等の基本料金

区分	利用料（1日当たり）
クリーンルーム（イエロールームを含む）に設置された装置等を利用する場合	3,348円
加工・評価室に設置された装置等を利用する場合	1,188円

備考

- 1 上記表中の利用料は、1日当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに実験室等の利用日数を乗じた金額を1人当たりの基本料金とする。
- 2 複数の者が実験室等を利用する場合については、上記1の1人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とする。
- 3 1人でクリーンルーム及び加工・評価室を併せて利用する場合については、クリーンルームの料金を基本料金とする。

別表第4 技術代行等における技術料

区分	利用区分	1時間当たり	1日当たり	
技術補助	微細構造解析装置群利用者	第3条第1項ただし書きに掲げる者	540円	4,320円
		上記以外	1,080円	8,640円
技術代行	上記以外	2,700円	21,600円	

備考

- 1 上記表中の料金は、1日又は1時間の技術代行にかかる金額（消費税相当額を含む。）であり、これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とする。
- 2 1時間未満の技術代行及び1時間を超える技術代行に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行として、技術料を算出するものとする。

別表第5 サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

実験室等	利用料	
	1日当たり	1時間当たり
サテライトラボ（専有部分）	165円	21円
セミナー室		

備考

- 1 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む。）であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とする。
- 2 1時間未満の実験室等利用及び1時間を超える実験室等利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の実験室等利用として、利用料金を算出するものとする。
- 3 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料

金とする。

別表第6 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
利用開始日の8日前から30日前まで	利用負担金の額の50%
利用開始日当日から7日前まで	利用負担金の額の100%

備 考

- 1 利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、第2条第2項、第3項及び第4項に基づき算出した額とする。
- 2 キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとする。